

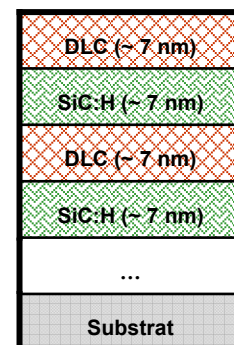
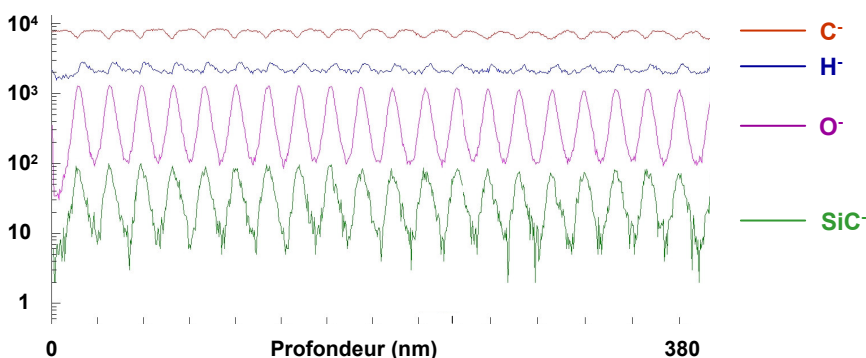
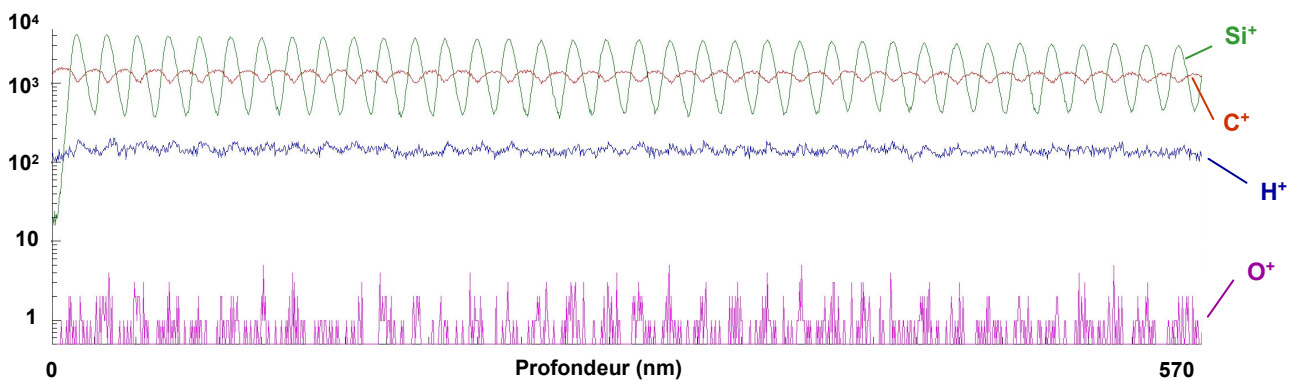
V2

**Objet :** Caractérisation d'un empilement de plusieurs centaines de couches alternées de DLC / SiC:H de quelques nanomètres d'épaisseur chacune (~ 7 nm), pour une épaisseur totale de quelques microns, utilisées pour des applications mécaniques et tribologiques

**Technique mise en œuvre :** **SIMS**

- ✓ Epaisseur des couches ➔ quelques nm
- ✓ Epaisseur du dépôt ➔ quelques  $\mu\text{m}$
- ✓ Profils élémentaires de répartition en profondeur ➔ localisation des couches

#### Résultats :



#### Conclusion :

Contrôle de la composition, de l'épaisseur, du nombre de couches et de la structure de l'empilement avec une résolution meilleure que le nanomètre